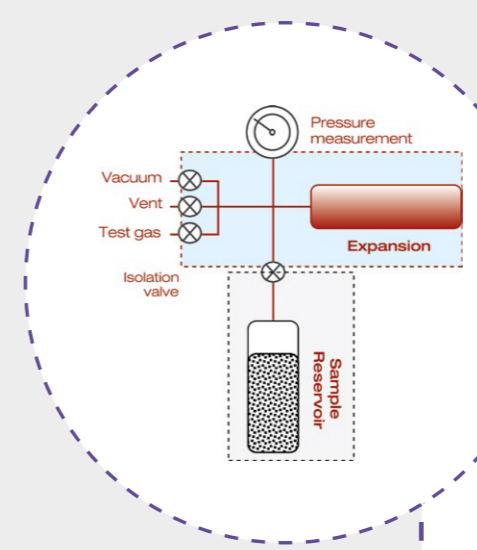




- **高精度版本**
降低测量过程中的，压力精度差带来累积误差。
- **宽广的温度范围可匹配各种不同的应用**
从低温至500℃，支持客户定制。
- **多种操作模式**
等温吸附，动力学和循环寿命，压力可至200 bar，可确定样品与气体相互作用的能力和速率及其老化特征。
- **微量样品测量**
Microdoser选项（专利号：US8132476）；
- **在线联用扩展功能**

基本参数	GASPRO
温度范围(°C)	低温~500℃ (更高温度可定制)不同的样品池选项
标定缓冲池	标定缓冲池，体积从5mL~1.2L
测试气体类型	CO ₂ , CH ₄ , N ₂ , Ar, H ₂ , He...
安全性	可燃气体报警装置，紧急泄爆口
压力	
操作压力范围	真空~200bar 压力调节：自动的PID压力控制 恒定P, ΔP 或 f(ΔP)
压力控制(调节)	2个压力传感器（真空~200bar）
样品室压力测量	1个高压传感器（真空~200bar） 精度：< 0.025% F.S. 1个低压传感器（真空~15bar） 精度：< 0.12% R.
灵敏度	3 μ mole (配置Microdoser)



GASPRO 使用一套高精度压力传感器用于精确测量，可尽量减少测量过程中的累积误差。

GASPRO 配置的高质量元器件：

- 已标定的缓冲池(5个可用)，精确的温度可控性和压力测量；
- 精密的压力控制单元；
- 15种自动控制程序用于等温线，动力学和循环寿命。

GASPRO样品池采用外挂式设计，方便连接各种体积和温度范围的样品池。

此种设计便于与其它设备进行在线同步联用，如量热仪。

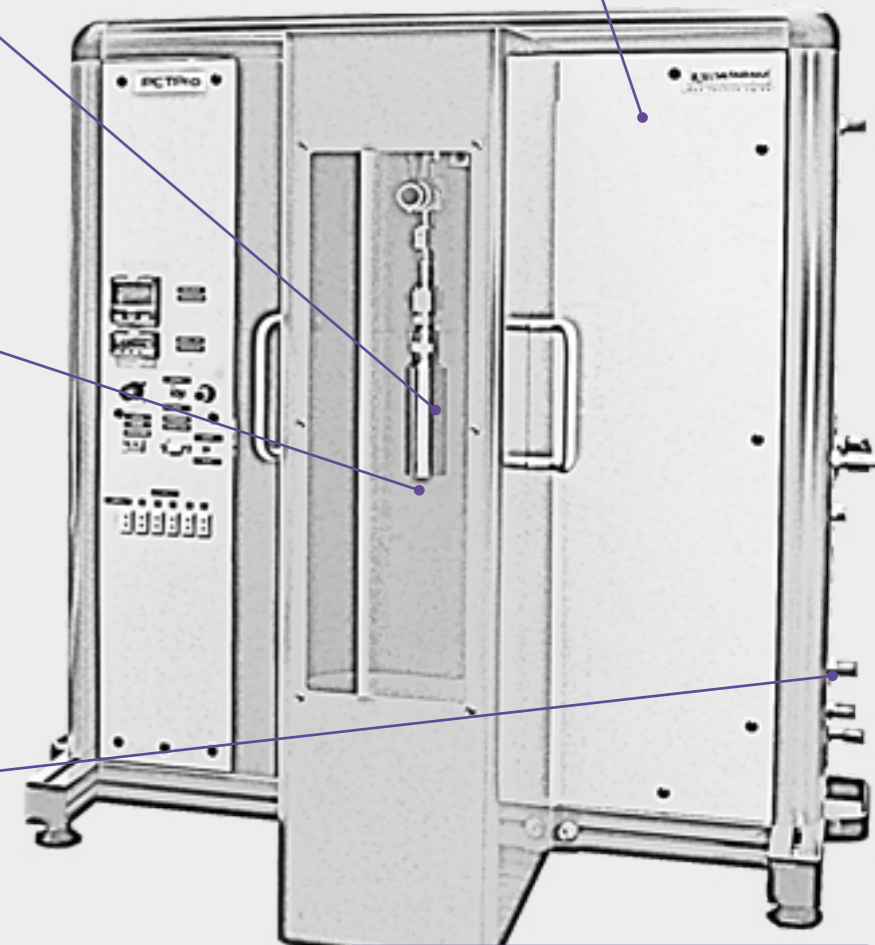
独一无二的Microdoser选项，使得低于100mg样品测试成为可能。

高温至500℃(更高需要定制)；
低温至-260℃(可满足各种需求)。

气体&真空连接

测试气体接口，气动阀气路，排气口，真空泵，氦气气路，安全泄压口。

均设计在主机侧面，便于工程师安装和维护。



GASPRO 剖面示意图